

半導体製造ガス流量ワーキンググループの活動報告

森岡敏博

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(AIST)
計量標準総合センター (NMIJ)
工学計測標準研究部門 (RIEM)
気体流量標準研究グループ長

背景と目的

半導体製造プロセスにおいて、ガス流量制御にはマスフローコントローラー（MFC）が使用されている。半導体デバイス及びプロセスの微細化により、**実ガス流量精度**の向上について、エンドユーザーや装置メーカーから下記のような要望がある。

- ✓ コンバージョンファクターの決定方法の標準化
- ✓ 装置の互換性 もしくは プロセス条件の再現性



半導体製造ガスの流量計測標準の開発

会員：

MFCメーカー
材料メーカー
半導体技術商社
半導体製造装置メーカー
技術コンサルタント
産総研

活動内容：

COCN（産業競争力懇談会）推進テーマ活動

COCN（産業競争力懇談会）とは

産業競争力懇談会(COCN)は、産業界の有志により、日本の産業競争力強化のため、科学技術・イノベーション政策や官民の役割分担などを政策提言としてとりまとめ、その実現を図る活動を行っています。

当会は、**COCN(Council on Competitiveness-Nippon)**と略称します。

出典：COCNホームページ
<http://www.cocn.jp>

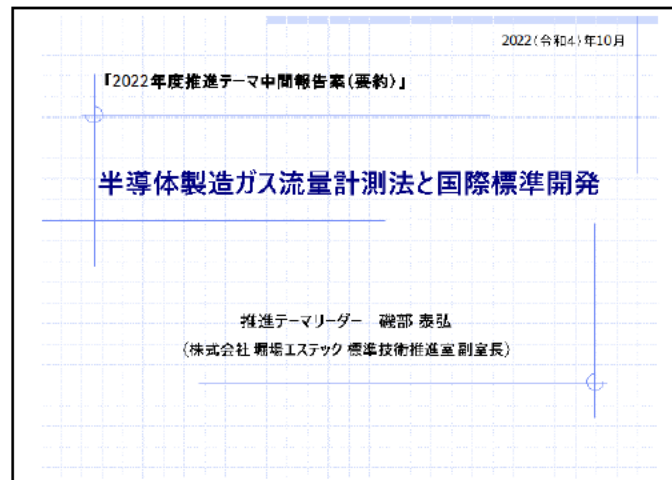
COCN（産業競争力懇談会）とは

2022年度推進テーマ

1. Ambient Energy Platformの構築と社会実装
2. 医療分野における色彩の標準化と社会実装
3. 浮体式原子力発電
4. カーボンニュートラル実現に向けた水力発電システム
5. 緑のエコシステム
6. 超電導で拓くカーボンニュートラル社会
- 7. 半導体製造ガス流量計測法と国際標準の開発**
8. DAC（Direct Air Capture）研究会
9. フード・サステナビリティ実現に向けたwell-being代替タンパク質の開発と社会実装

COCN推進テーマ活動

- ・ 中間報告書作成 (<http://www.cocn.jp/news/infoback/>)
- ・ 府省庁懇談会
 - 11月15日 内閣官房・内閣府
 - 11月30日 経済産業省
- ・ 最終報告書 (予定)



「2022年度推進テーマ中間報告案(要約)」

半導体製造ガス流量計測法と国際標準開発

推進テーマリーダー 磯部 泰弘

(株式会社 堀場エステック 標準技術推進室 副室長)